OPHTHALMO	LOGICAL EQUIPMENT	
Patent Number:	JP6327634	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Publication date:	1994-11-29	
Inventor(s):	SATO MASARU; others: 01	·
Applicant(s)::	TOPCON CORP	
Requested Patent:	☐ <u>JP6327634</u>	
Application Number	JP19930115776 19930518	
Priority Number(s):		
IPC Classification:	A61B3/12	•
EC Classification:		
Equivalents:		
	Abstract	

PURPOSE:To prevent an ophthalmological equipment capable of photographing a corneal endothelial cell and measuring the thickness of the cornea by a single equipment and lightening the burden on both an examiner and examinee.

CONSTITUTION: This equipment comprises: a lighting optical system 28 for irradiating the cornea C of an eye E to be examined with the lighting from a lighting sources 30, 32, an observation photographing optical system 29 for receiving the lighting reflected from the cornea C to observe and photograph the image on the cornea C; and an operation circuit for receiving the reflected light from the surface and the back of the cornea and for measuring the thickness of the cornea based on the distance between the two reflected lights.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開平6-327634

(43)公開日 平成6年(1994)11月29日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

A 6 1 B 3/12

A 6 1 B 3/ 12

D

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

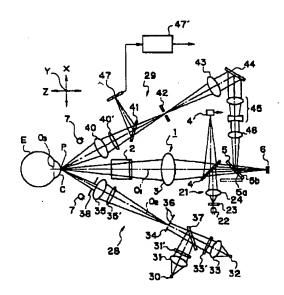
		
(21)出願番号	特顧平5-115776	(71)出顧人 000220343
		株式会社トプコン
(22)出顧日	平成5年(1993)5月18日	東京都板橋区蓮沼町75番1号
		(72)発明者 佐藤 勝
		東京都板橋区蓮沼町75番1号株式会社トプ
		コン内
		(72)発明者 森本 章夫
		東京都板橋区蓮沼町75番1号株式会社トプ
		コン内
		(74)代理人 弁理士 西脇 民雄

(54) 【発明の名称】 眼科装置

(57) 【要約】

【目的】 単一の装置で角膜内皮細胞の撮影と角膜厚さ の測定とを実行することができ、しかも、検者、被検者 にかかる負担が小さい眼科装置の提供を目的とする。

【構成】 照明光源30,32からの照明光を被検眼E の角膜 C に向けて斜めから照射する照明光学系28と、 角膜Cから反射された照明光を受光し、角膜Cの像を観 察摄影する観察撮影光学系29と、角膜Cの表面および 裏面から反射された反射光を受光し、2つの反射光の間 隔に基づいて角膜の厚さを測定する演算回路53とを備 えることを特徴とする眼科装置。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 照明光源からの照明光を被検眼の角膜に向 けて斜めから照射する照明光学系と、

前記被検眼からの反射光を受光し、角膜内皮細胞の像を 含めて前記角膜の像を観察撮影する観察撮影光学系と、 前記被検眼からの反射光を受光し、前記角膜の厚さを測 定する測定手段とを備えることを特徴とする眼科装置。

【請求項2】前記測定手段は、前配照明光学系から発し て前記角膜の表面および裏面から反射された反射光を受 光し、2つの反射光の間隔に基づいて角膜の厚さを測定 10 する測定手段とを備えることを特徴とする請求項1に記 載の眼科装置。

【請求項3】前記観察摄影光学系は、装置と被検眼と前 後方向のアライメント状態を検知する微小光電素子列か らなる光電変換素子を有し、前記測定手段は、前配光電 変換素子から出力される信号のうち、前記角膜の表面及 び裏面から反射された反射光束に対応する光電変換信号 に基づいて角膜厚さを測定することを特徴とする請求項 2に記載の眼科装置。

【請求項4】前記照明光学系の光軸と前記観察撮影光学 20 系の光軸とは、前記被検眼の前眼部を観察する前眼部観 察光学系の光軸に対して対称に配置されていることを特 徴とする請求項1に記載の眼科装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、被検眼の角膜内皮細 胞の撮影と角膜厚さの測定との両機能を有する眼科装置 に関する。

[0002]

さの測定との両機能を有する装置としては、被検眼の角 膜表面にコーンレンズを接触させて撮影、測定する接触 式のものが開発されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 撮影測定装置は、被検眼の角膜表面にコーンレンズを接 触させて撮影し、あるいは測定するため、被検者の目に 点眼麻酔をしなければならず、また、角膜表面に損傷を 与えかねず、さらに、感染の危険性を避けるためにコー ンレンズの消毒を必要とし手間がかかるため、検者、被 40 検者ともに負担が多い。

[0004]

【発明の目的】この発明は、上述した従来技術の課題に 鑑みてなされたものであり、単一の装置で角膜内皮細胞 の摄影と角膜厚さの測定とを実行することができ、しか も、検者、被検者にかかる負担が小さい眼科装置の提供 を目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】この発明は、上記の目的 を違成させるため、照明光源からの照明光を被検眼の角 50 眼に投影する投影レンズ11とから構成されている。固

膜に向けて斜めから照射する照明光学系と、被検眼から の反射光を受光し、角膜内皮細胞の像を含めて角膜の像 を観察撮影する観察撮影光学系と、被検眼からの反射光 を受光し、角膜の厚さを測定する測定手段とを備えるこ とを特徴とする。

[0006]

【実施例】以下、この発明にかかる角膜内皮細胞撮影及 び角膜厚さ測定装置の一実施例を図1~図12に基づい て説明する。

【0007】図1及び図2は、角膜内皮細胞撮影及び角 膜厚さ測定装置の光学系を示す。被検眼Eの前眼部を観 察する前眼部観察光学系1は、ハーフミラー2、対物レ ンズ3、ハーフミラー4、光路切り換えミラー5、CC D(撮像素子)6から大路構成され、O1はその光軸であ

【0008】光路切り換えミラー5は、一方側が遮光面 5a、他方側が全反射面 5bとされ、前眼部を観察する際 には、図中二点鎖線で示したように光路から退避され る.

【0009】ハーフミラー2は、図2に示されるアライ メント指標光投影光学系8、及び固視標光投影光学系1 4からの光束を被検眼に導くために設けられている。

【0010】アライメント指標光投影光学系8は、赤外 光を発するアライメント用光源9、ピンホール板10、 このピンホール板10に焦点を一致させるように配置さ れた投影レンズ11、ハーフミラー12を有する。光源 9から発してピンホール板10を透過したアライメント 指標光Kは、投影レンズ11により平行光束とされ、ハ ーフミラー2で反射された後、図3に示すように、角膜 【従来の技術】従来から、角膜内皮細胞の撮影と角膜厚 30 頂点Pと角膜曲率中心O3との間の中間位置に輝点像R を形成するようにしてその表面下で反射される。

> 【0011】角膜Cからの反射光束は、ハーフミラー2 を介して対物レンズ3を介してハーフミラー4に導か れ、その一部がハーフミラー4によって反射され、受光 手段としてのアライメント検出センサ4~に導かれる。 アライメント検出センサ4 ~には、例えばPSD(Posit ion Sensitive Device)のような位置検出可能なセンサ が用いられる。

> 【0012】また、ハーフミラー4を挟んでアライメン ト検出センサ4 に対向する位置には、アライメントパ ターン投影光学系21が設けられている。アライメント パターン投影光学系21は、アライメントパターン用光 源22、アライメントパターン板23、投影レンズ24 から構成されている。アライメントパターン板23には 円環状パターンが形成されており、このパターン板を透 過したパターン形成光束の一部は、ハーフミラー4によ って反射され、CCD6に違する。

> 【0013】一方、固視標光投影光学系14は、固視標 用光源17と、この光源17から発した固視標光を被検

視標用光源17は、この例では図4に示すように複数の 発光ダイオード18,18,…が放射状に配列して構成 されており、任意の箇所の発光ダイオードを選択的に点 灯させることにより、被検者の視線方向を変化させるこ とができる。

【0014】なお、固視標用光源としては、図5(a)に 示すように発光ダイオードを二次元に正方配列して構成 してもよいし、図5(b)に示すように発光ダイオードを 同心円状に配列して構成してもよい。また、図5(c)に 示すように単一の発光ダイオードを移動可能に設けて構 10 成すればよい。 成してもよい。

【0015】前眼部照明光源7によって照明された被検 眼Eの前眼部の像は、対物レンズ3を介してCCD6上 に形成される。また、CCD6には、ハーフミラー4を 透過したアライメント指標光、ハーフミラー4で反射さ れたアライメントパターン投影光学系21からのアライ メントパターン光も到達する。CCD6からの画像信号 を受けたモニター装置25には、図6に示したように被 検眼Eの角膜C、瞳孔Puを含む前眼部像26、パター ン光による円環状パターン像27、アライメント指標光 20 による輝点像R「が形成される。

【0016】前眼部観察光学系1の両側には、図1に示 すように照明光学系28と観察摄影光学系29とが設け られている。照明光学系28は被検眼Eの角膜Cに向け て斜め方向から照明光束を照射する。 照明光学系28 は、ハロゲンランプを用いた観察用照明光源30、集光 レンズ31、赤外フィルター31、キセノンランプを 用いた撮影用照明光源32、集光レンズ33、波長選択 フィルター33~、ダイクロイックミラー37、スリッ 5 、 開口絞り38を有する。観察用照明光源30に は、ハロゲンランプの代わりに赤外LEDを用いてもよ い。この場合には、赤外フィルター31~を省くことが できる。

【0017】観察用照明光源30から出射して集光レン ズ31により集光され、赤外フィルター31 を透過し た赤外光は、ダイクロイックミラー37によって反射さ れスリット板34に導かれる。撮影時には撮影用照明光 **版32から発した光束も、集光レンズ33により集光さ** れ、角膜内皮細胞像のコントラストを上げるための波長 40 選択フィルター33~を介してダイクロイックミラー3 7を透過し、スリット板34に導かれる。スリット36 を通過した光束は、投光レンズ35、スリット36と同 方向の閉口絞り38を通り角膜Cに導かれ、角膜Cをそ の表面Tから内部に向かって横切るよう照明する。

【0018】スリット板34には、Y方向に細長い角膜 内皮細胞撮影用の幅の広いものと角膜厚さ測定用の幅の 狭いスリット36が設けられており、光束中に選択的に 挿入できるよう切り換え可能となっている。 スリット板 34の代わりに、スリット幅を連続的に変化させること 50 によるピーク部である。符号Vは角膜Cの内皮細胞部分

ができる可変スリットを用いてもよい。

【0019】なお、この実施例では、波長の長い赤外光 を使用する観察時に凸レンズ35~を光路中に挿入し、 波長の短い可視光を使用する撮影時にこれを光路から離 脱させることにより、いずれの光源を用いたときにも被 検眼E側での光束の集光位置が変化しないよう構成して いる。光路長補正部材としては、他に平行平面板あるい は凹レンズを用いることもできる。この場合には、撮影 時に平行平面板等を挿入し、観察時に離脱させるよう構

【0020】観察撮影光学系29は、対物レンズ40、 光路長補正用の凸レンズ40~、ハーフミラー41、マ スク42、リレーレンズ43、ミラー44、変倍レンズ 45、合焦レンズ46、光路切り換えミラー5から構成 されている。角膜内皮細胞の観察、撮影時には、光路切 り換えミラー5が図1の実線で示されるように光路内に **挿入される。なお、凸レンズ40~の機能は、照明光学** 系28における凸レンズ35~と同一であり、使用波長 に応じて光路に挿入され、あるいは離脱される。

【0021】図7は、照明光学系28により投光された スリット光束しの角膜Cにおける反射の様子を示す。ス リット光東しの一部は空気と角膜Cとの境界面である角 膜表面Tにおいてまず反射される。その角膜表面Tから の反射光束L´の光量が最も多い。角膜内皮細胞Nから の反射光束N´の光量は相対的に小さく、角膜実質Mか らの反射光束M´の光量が最も小さい。

【0022】角膜Cからの反射光束は、対物レンズ40 により集光されてハーフミラー41に導かれる。ハーフ ミラー41を通過した反射光束は、マスク42の位置で ト板34、投光レンズ35、光路長補正用の凸レンズ3 30 一旦結像する。マスク42は、角膜内皮細胞像を形成す る以外の余分の反射光束を遮光する。マスク42を通過 した反射光束は、リレーレンズ43、ミラー44、変倍 レンズ45、合焦レンズ46を介して光路切り換えミラ - 5 で反射され、CCD 6上に角膜内皮細胞の像を高倍 率で形成する。

> 【0023】モニター装置25には、角膜内皮細胞像4 8が図8に示すように表示される。図8において、破線 で示す49はマスク42によって遮光されないとしたら 角膜表面下からの反射光束し、により形成される光像で あり、50は角膜実質Mからの反射光束M´による光像 である。また、図8の斜線部分はマスク42によって遮 光された部分である。

> 【0024】ハーフミラー41により反射された反射光 束は、結像位置のマスク42と共役の位置にある合魚状 態検知センサとしてのラインセンサ47に導かれる。ラ インセンサ47は、角膜Cの断面方向に対して図9(ロ) に示すように配置されており、反射光束の強度分布は図 9(イ)に示すようなものとなる。図9(イ)において、符 号Uは角膜Cの表面Tにおいて反射された反射光束L^{*}

Nにおいて反射された反射光東N´によるピーク部であ る。そのピーク部ひは光像49に対応し、ピーク部Vは 光像48に対応する。なお、ピーク部の検出とピーク部 の中心検出には公知の手段を用いる。

【0025】ラインセンサ47の出力は、図1に示すよ うに判断回路47~に入力される。判断回路47~は図 9(イ)に示すような、ピーク部U部及びピーク部Vの信 号を記憶し、演算処理をすることにより角膜内皮細胞部 分からの反射光のピーク部Vの中心番地V、を判断する に一致するか否かを判断する。装置光学系はピーク部V の中心番地V、が所定番地Qに一致するとき、角膜内皮 細胞に焦点が合うように設定されている。

【0026】角膜厚さ測定の時は、角膜厚さ測定用の幅 の狭いスリット光により角膜を照明する。このときライ ンセンサ47上の反射光束の強度分布は、図9(ハ)に示 すようにスリット幅に比例して上記角膜内皮細胞撮影の 時より幅の狭い光量分布となる。前配と同様に演算処理 をすることによりピーク部8の中心番地8 とピーク部 α の中心番地 α を判断すると共に、ピーク部 β の中心 20 番地β´がラインセンサ47の許容範囲所定番地Qに入 ったとき、ピーク部βの中心番地β をピーク部αの中 心番地α´の間隔Wを演算処理し記憶する。

【0027】このときスリット幅を狭くすることは、ピ ーク部βおよびピーク部αの幅が狭くなると共に、角膜 実質Mからの反射光束による光像50に相当する部分の 光量 W^* が少なくなり、中心番地(β^* 、 α^*)および間 隔Wの精度向上が図れる。

【0028】ここで、間隔Wは、図10の概略図で示す 角膜位置において、照明光学系28の光軸O2が角膜C 30 点灯している発光ダイオード18の位置情報を、角膜内 の表面Tと交差する点aから、観察撮影光学系29の光 軸〇4に下ろした垂線の交点dまでの距離に相当する。 角膜の厚さは頂点Pと点bとの間隔であるため、装置の 光軸角 8 とラインセンサ47の位置の像倍率及び角膜の 表面曲率を与えることで角膜厚さを演算できる。このと き、角膜の表面曲率は、各々の被検眼角膜の値を入れる ようにしてもよいし、標準表面曲率を用いてもよい。な お、上記説明は角膜Cと空気の屈折率の相違を無視した ものであり、実際は屈折率を考慮し補正を加え角膜厚さ

【0029】角膜厚さ測定の精度向上のために、複数回 測定して平均演算するようにしてもよく、また、アライ メント許容範囲を角膜内皮細胞撮影のときより狭く設定

【0030】このように、実施例の装置によれば、角膜 内皮細胞観察撮影のために設けられた合焦検出センサと してのラインセンサ4?の出力を角膜厚さの測定にも兼 用することができ、それぞれ別個の光学系を設けること と比較すると、構成が簡略となり、機能の増加に伴うコ ストの増加を小さく抑えることができる。

【0031】図11は、実施例の装置の制御系を示すプ ロック図である。この例では、ラインセンサ47、判断 回路47、制御回路51、演算回路53が被検眼から の反射光を受光し、角膜の厚さを測定する測定手段を構 成している。

【0032】判断回路47~には、ラインセンサ47か ら出力される装置の被検眼に対する 2 方向(前後)の位置 を示す信号と、アライメント検出センサ4~から出力さ れる X Y 方向(上下、左右)の位置を示す信号とが入力さ と共に、この番地 V ´ がラインセンサ47の所定番地Q 10 れると共に、角膜内皮細胞の撮影と角膜厚さの測定との モードを切り換えるモード切換スイッチ52からの選択 信号が入力される。

> 【0033】判断回路47 は、モード切換スイッチ5 2からの選択信号に応じて、それそれの撮影、測定に資 した幅のスリット36が選択されるようスリット板34 を駆動すると共に、制御回路51に信号を出力する。な お、スリット板34を手動で切り換える構成とし、この 切換に応じてモードが選択されるように構成してもよ 41.

【0034】制御回路51は、角膜厚さの測定に関する 演算をする演算回路53と、CCD6とを制御する。演 算回路53により求められた角膜厚さの値は、プリンタ −56により出力されると共に、合成回路54によりC CD6の出力と合成され、モニター25に角膜内皮細胞 の像と重ね合わせて表示される。モニター25の表示結 果は、プリンター56によりプリントアウトできる。

【0035】また、撮影された角膜内皮細胞像、瀕定さ れた角膜厚さが角膜のどの部位に対応するかを特定する ため、被検眼の固視方向を選択した固視標用光源17の 皮細胞撮影像又は角膜厚さ測定結果と共にプリントアウ **トできる。**

【0036】図12は、上記の装置による撮影、測定の 制御を示すフローチャートである。判断回路47~は、 アライメント検出センサ4 による位置検出値が上下左 右方向のアライメント許容範囲に入り、上記角膜内皮細 胞部分からの反射光のピーク部Vの中心番地V ´ がライ ンセンサ47の前後方向の許容範囲所定番地Qに入った とき、選択されたモードに関する情報とラインセンサ4 7の出力とを制御回路51へ出力する。

【0037】制御回路51は、角膜内皮細胞の撮影が選 択されている場合には、光源7, 9, 17, 22を消灯 させ、観察用照明光源30を消灯または減光させ、光路 長補正用レンズ35~、40~を光路から退避させると 共に、光路切換ミラー5を光路中に挿入し、撮影用照明 光源32を点灯させてCCD6に対して撮影を指示す る。光路切換ミラー5を光路中に挿入すると、モニター 装置25の画面が前眼部像画面(図6)から角膜内皮細胞 画面(図8)へと切り換えられる。

50 【0038】モード切換スイッチ52により角膜厚さの

測定が選択さている場合には、アライメント、合焦動作 の終了後、ラインセンサ47からの出力信号に基づいて 演算回路53が角膜厚さを測定演算する。

【0039】なお、上配の実施例の装置は、角膜内皮細 胞撮影像と角膜厚さ測定とを別々に実行する構成である が、角膜内皮細胞撮影のときXY方向及び2方向のアラ イメントが終了して、光源(7、9、17、22、30) が消灯又は減光する前に、ラインセンサ47の出力を配 憶して角膜厚さ測定を行うようにしてもよい。

【0040】この場合には、スリット構造を図13に示 10 ロック図である。 すように全光束を透過させる狭いスリット57の両側 に、可視光を透過させ、赤外光をカットさせる波長選択 フィルター58を設け、アライメント光と観察用の照明 光とが狭いスリット57を透過し、撮影用の照明光が不 透過部分59で区切られた広いスリット60を透過する よう構成すればよい。

[0041]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、角膜内皮細胞の撮影と角膜厚さの測定とを単一の装 置で実行することができ、一回のアライメントで角膜内 20 7…前眼部照明光源 皮細胞の撮影と角膜厚さの測定とを連続して行なうこと ができる。また、撮影、測定共に被検眼に対して非接触 で実行することができる。したがって、検者、被検者に かかる負担を共に軽減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施例にかかる眼科装置の前眼部 観察光学系、照明光学系、観察撮影光学系を示す光学系 の説明図である。

【図2】 実施例の装置のアライメント指標光投影光学 系、固視標投影光学系を示す説明図である。

【図3】 角膜におけるアライメント指標光束の反射状 態を示す図である。

固視標用光源の構成を示す説明図である。 [図4]

【図5】 固視標用光源の変形例を示す説明図である。 【図6】 前眼部像の表示状態を示す説明図である。

【図7】 角膜におけるスリット光束の反射状態を示す 図である。

【図8】 角膜内皮細胞像の表示状態を示す図である。

【図9】 角膜内皮細胞像とラインセンサに受光される 光量との対応関係を示す図である。

【図10】 反射光により角膜厚さを求める原理を説明 する角膜の拡大図である。

【図11】 実施例にかかる眼科装置の制御系を示すプ

【図12】 実施例にかかる眼科装置の制御を示すフロ ーチャートである。

【図13】 実施例の変形例に用いるのに適したスリッ トの説明図である。

【符号の説明】

1…前眼部観察光学系

2…ハーフミラー

3…対物レンズ

6 ··· C C D

8…アライメント指標光投影光学系

9…アライメント用光源

4 ~…アライメント検出センサ

5…光路切換ミラー

21…アライメントパターン投影光学系

28…照明光学系

29…観察摄影光学系

30…観察用照明光源

32…摄影用照明光源

30 36…スリット

37…ダイクロイックミラー

47…ラインセンサ

47 一、判断回路

[図7] [図2] 【図3】 【図4】

